

PFリング、PF-ARからの入射器への要望

PF光源系 小林幸則

2004-06-02

当面

- ・KEKB(e^+/e^-)同時連続入射しても、現状と同等な入射（定時入射およびマシンスタディ時の不定期、連続入射）ができること。

将来

- ・PFリングは、TOP-UP運転モードを加えたい。
- ・PF-ARは、入射エネルギーを4.0GeVに上げたい。